

11

# ガス処理システム

# 1 1 ガス処理システム

## 課題

ハロゲン（フッ素、塩素等）や酸性ガス（硫化水素、塩化水素等）を含む排ガスの処理技術の開発

## 特徴

吸収材充填層に吸収剤供給機構と吸収剤排出機構を設けることにより、上・下反応帯が形成され、一個の吸収剤充填室で二種類のハロゲン含有ガスの処理を実現

## 用途

ダイオキシンを含む排ガス処理や加流工程を有するゴム工場等からの排ガス処理

# ガス処理システム

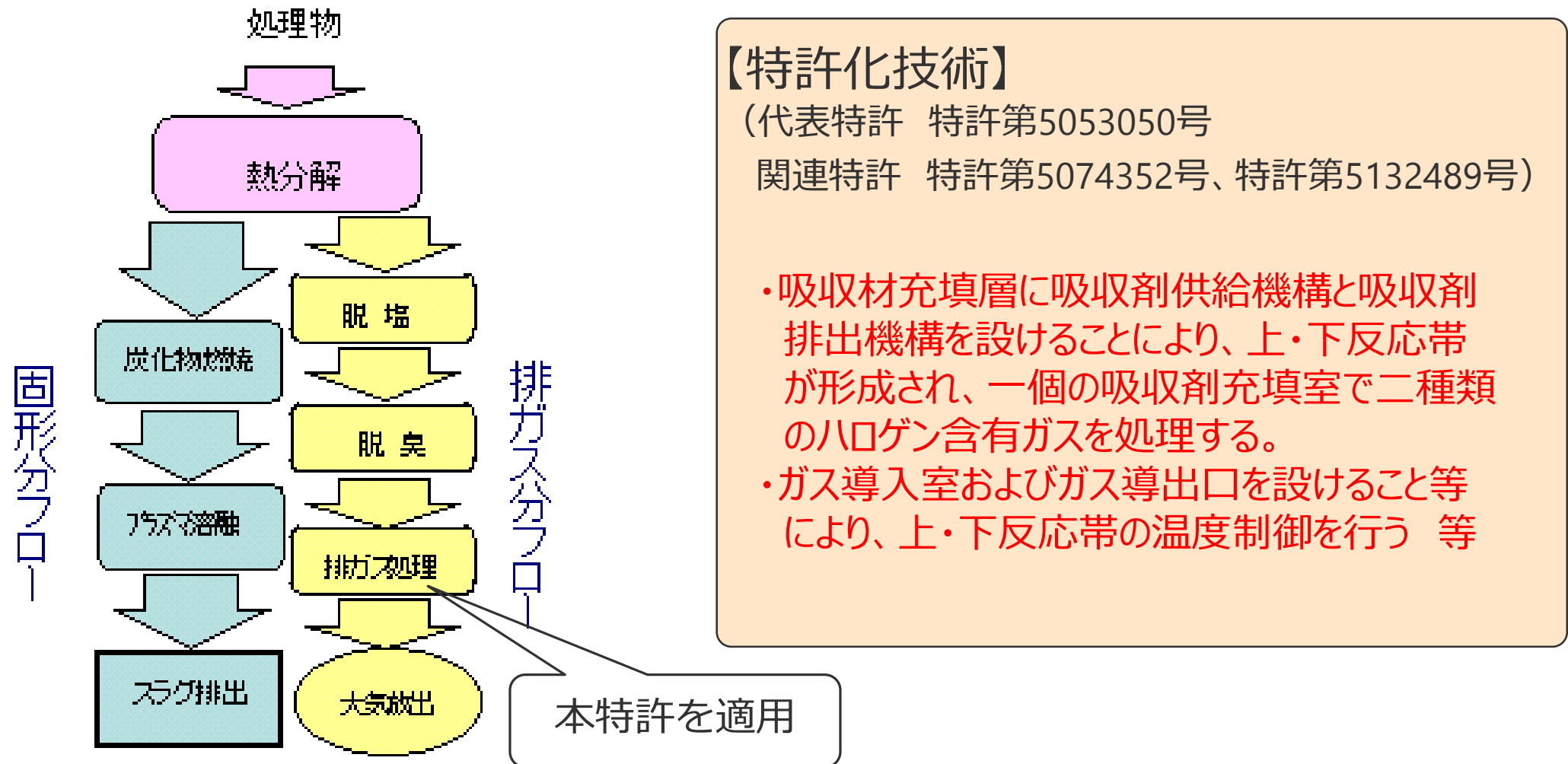


図 本特許を適用した医療廃棄物処理装置のフロー